# 氧流量对热蒸发 CVD 法生长 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米材料 的结构及发光特性的影响<sup>\*</sup>

#### 马海林 苏 庆 兰 伟 刘雪芹\*

(兰州大学物理科学与技术学院,兰州 730000) (2008 年 3 月 30 日收到 2008 年 5 月 12 日收到修改稿)

用热蒸发 CVD 法制备了 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米材料,并用光致发光(PL)方法研究了其发光特性. X 射线衍射分析显示,产物为单斜结构的 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 扫描电子显微镜测试表明:在较小氧流量条件下制备的产物为 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米带,宽度小于 100 nm,长度有几微米;较大氧流量时制备出 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米晶粒结构,晶粒尺度在 80—150 nm. PL 的测试表明:β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米结构在波长 516 nm 处有很强的绿色发光带,且随着氧流量的逐渐增加发光强度逐渐减弱.在氧气氛中 900℃退火 2 h 处理后,发光强度减弱,进一步证实氧空位缺陷是 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米材料发光的主要因素.

关键词:光致发光,氧流量,纳米结构,Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> PACC:7855E,7360L,6170A

### 1.引 言

 $Ga_2O_3$  是一种多功能材料<sup>[12]</sup>,在磁学、光学和 半导体领域备受关注,它具有禁带宽度高,电子漂 移饱和速度快,介电常数小,热稳定性好,耐高温 性能好,在室温下不溶于水、酸、碱、化学稳定性好 等诸多优良性能. $Ga_2O_3$  晶体有  $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ , $\delta$  和  $\varepsilon$  等多 种形态<sup>[3]</sup>,其中最为常见的是六方结构的  $\alpha$  相和单 斜结构的  $\beta$  相,在 380°C下, $\alpha$  相可直接转变为  $\beta$ 相. $Ga_2O_3$  最突出的特性属它是一种性能优越的宽 带隙半导体材料(室温下带隙宽约为 4.8 eV )<sup>4]</sup>,是 制造高亮度蓝、绿光发光器件的优质材料<sup>[56]</sup>,同时 它还作为一种透明的氧化物半导体,在光电子器件 方面有着广阔的应用前景<sup>[78]</sup>,可用作 Ga 基半导体 材料的绝缘层,以及紫外线滤光片<sup>[9—11]</sup>.

目前,对于纳米 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的研究主要集中在材料 制备方面,人们已经用不同方法合成,例如,碳热还 原法、气相外延法、热退火法、物理蒸发法等,而有 关光学性能方面的研究较少,尤其是研究工艺参数 对 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的光致发光的影响. Blasse 等人<sup>[12]</sup>认为 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 晶体的缺陷带发射很可能归因于 Ga 空位、O 空位、以及 Ga-O 空位对( $V_0$ ,  $V_{Ga}$ ). Harwig 等<sup>[11]</sup>认 为施主上的一个电子和受主上的一个空穴的重新组 合是 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米结构发蓝光或绿光的主要原因.本 文用热蒸发 CVD 方法得到 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的纳米带和纳米 晶粒,研究了氧流量对生长 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米材料的结 构和发光特性的影响.

#### 2. 实验方法

以金属镓为原料在水平高温真空管式炉中制备 得到  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米材料.将单晶硅片在丙酮溶液中 超声波清洗 30 min,烘干后溅射一层 20 nm 厚的金 膜作为催化剂.500 mg 高纯镓(99.999%)置于氧化 铝舟中,镀有金膜的硅片衬底放置在距离蒸发源 10 mm下游,然后将装有蒸发源和衬底的氧化铝舟放 入管式炉中.系统抽真空并通氩气反复清洗后,以 20℃/min 的速率升温分别加热至 1050℃,然后通入 Ar(60sccm)和 O<sub>2</sub>(2.5,10,20 sccm),系统压强维持 在 5×10<sup>2</sup> Pa 下保持 60 min.反应结束后,观察到在 衬底上均有白色絮状物质.

用 X 射线衍射仪(XRD, JAPAN RIGAKU D/Max - 2400, Cu/Kα radiation, λ = 0.15405 nm)对样品进

<sup>\*</sup>国家自然科学基金(批准号:50402024,50872047)资助的课题.

<sup>†</sup> 通讯联系人. E-mail:xqliu@lzu.edu.cn

行物相分析.场发射扫描电子显微镜(FE-SEM,S-4800)对样品的形貌进行观察.室温条件下用 RF-540型荧光光谱仪进行光致发光性能的测试.

#### 3. 实验结果与讨论

图1为不同氧流量条件下制备的样品的 X 射 线衍射图. 结果表明不同实验条件下制备的样品结 构基本相同,均为单斜结构的多晶β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,属于 C2/m 点群. 计算其晶体结构常数为 a = 5.81Å, b = 3.04Å, c = 12.23Å, β = 103.7°( 卡片号: ICDD PDF NO. 76-0573 ). 由于 Au 膜较薄, 所以在样品的 掠角入射 X 射线衍射谱图中并未观察到 Au 的峰. 值得注意的是随着氧流量的增加,样品的衍射峰强 度逐渐增强. 由 Sherrer 公式  $D = K \lambda (W \cos \theta)$  )可以 计算得到样品的晶粒尺寸,结果如图2所示.发现 样品的晶粒尺寸随着氧流量的增加逐渐变大。这是 因为氧流量增加,反应气氛中的氧浓度增大,使得 金属镓和氧气反应的更加充分,有利于晶粒的长 大,样品的结晶度也逐渐好转.换言之,随着氧浓 度的增加,样品中的氧空位缺陷逐渐减少,这也是 衍射峰强度增强的一个原因. Binet 等人<sup>[13]</sup>也认为 衍射峰强度增强是跟样品中氧的缺陷的减少有关。





图 3 为不同氧流量实验条件下制备的  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米结构的 SEM 形貌图:在较低氧流量时(O<sub>2</sub>:2 sccm)时形成尺度较为均匀的  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米带,宽度 小于 100 nm,长度有几微米甚至几十微米如图 3 (a);氧流量较大时制备的三个样品为纳米晶粒结 构,晶粒尺度在 80—150 nm 如图  $\mathfrak{X}$  b)(c)(d);说



图 2 样品晶粒尺寸随氧流量的变化

明氧气流量对热蒸发 CVD 法制备 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>纳米材料的形貌有很大影响.

用谢乐公式计算的是晶粒大小,而电镜照片观 察到的是颗粒尺寸.一般一个颗粒不只包含一个晶 粒,这也是本文中电镜照片观察到的尺寸要比用谢 乐公式计算的更大的原因.

分析 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米结构生长机理<sup>[14,15]</sup>, 在较高的温度下, 催化剂 Au 与气相物质一起形成共溶的 合金液滴, 从而在气相反应物和衬底之间形成一个 对气体具有较高容纳系数的气液界面层, 该界面层 不断吸收气相中的 Ga 和 O 形成过饱和后, 界面层 在衬底表面析出原子形成晶核促使晶体生长. 晶体 生长的形貌和过饱和度有密切关系, 在较大的氧气 流量时, 过饱和度大, 成核速度快, 容易形成晶粒 状 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; 相反, 在较低的过饱和度中容易形成 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米带.

图4 是在不同氧流量实验条件下制备的 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米材料的室温光致发光谱,激发光波长为 325 nm. 从图中可以看出在波长 516 nm 处有一很强 的绿色发光带. 随着氧流量的增加,发光强度逐渐 减弱.

有关 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米结构的蓝光或绿光发射峰形 成的发光机理 ,有文献报道<sup>[13]</sup>认为晶体缺陷导致 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的发绿光 , 晶体的缺陷带发射很可能归因于 Ga 空位、O 空位以及 Ga-O 空位对. Blasse 等<sup>[12]</sup>提出 氧空位缺陷( $V_0$ )作为施主 ,受主是由镓和氧的空位 对( $V_0$ , $V_{Ga}$ )构成 , 施主上的一个电子和受主上的一 个空穴复合是 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 发蓝光或绿光的原因.

我们在高温条件下合成 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米结构 , 很容易形成大量的氧空位缺( $V_0$ )以及镓和氧的空位



图 3 不同氧流量条件下制备的样品的 SEM 照片 (a) O<sub>2</sub>:2 sccm;(b) O<sub>2</sub>:5 sccm;(c) O<sub>2</sub>:10 sccm;(d) O<sub>2</sub>:20 sccm



图 4 不同氧流量下制备的样品的光致发光谱

对( $V_0$ ,  $V_{Ga}$ ). 在波长 325 nm 紫外光的激发下, Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的价带电子被激发到导带上,在导带中自由 运动,最终弛豫到氧空位缺陷形成的施主带上,与 镓-氧空位对形成的受主带发生复合,从而发射绿 光(图5所示). 随着氧流量的增加,样品的 PL 谱强 度逐渐减弱,说明氧流量的增加使样品中氧空位缺 陷减小,导致发光强度减弱.氧流量为  $2 \operatorname{scem}$ 时,形成的  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>纳米带尺度较小、比表面积较大,容易形成浓度很强的氧空位缺陷,所以  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>纳米带样品的发光强度最强.





图 6 在氧气氛中 900℃退火 2 h 后样品的光致发光比较图

为了进一步研究 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>纳米结构的发光起源, 我们将所有样品在氧气氛中 900℃退火 2 h,然后再 测其 PL 谱,如图 6 所示.发现除了氧流量在 20 scem 下制备的样品的 PL 谱发光强度几乎没有发生 变化外,其余样品的 PL 谱发光强度均有所减弱. 我们认为在氧流量在 20 scem 时制备的 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>纳米 晶样品,由于氧流量较高,样品中的氧空位缺陷浓 度接近饱和,即使将样品在氧气氛中 900℃退火 2 h 后其氧空位缺陷浓度也基本不变,所以退火前后样 品的 PL 强度几乎没有发生变化.氧流量较低时制 备的另外三个样品中含有大量的氧空位缺陷,在氧 气氛中 900℃退火2h后,样品中的氧空位缺陷浓度 大大减小,所以 PL 强度显著下降.从图 6 可以看 出,在氧流量为 2 sccm 时制备的 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>纳米带的 发光强度退火前后变化最大,这是因为纳米带的比 表面积大、更容易形成氧空位缺陷,同时退火时与 氧复合也最强,导致退火前后发光强度变化也最 大.这就进一步说明氧空位缺陷是 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>纳米材 料发光主要原因.

#### 4.结 论

用热蒸发 CVD 法在不同实验条件下制备了  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>纳米结构,并研究了样品的室温荧光光谱.研 究发现,氧流量的不同导致氧化镓形貌的不同,较低氧流量更有利于  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米带的形成,宽度小于 100 nm,长度有数微米;氧流量较大时产物为大量  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米晶粒,晶粒尺度在 80—150 nm. PL 测试表明,氧空位缺陷使  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米结构在波长 516 nm 处形成绿光发光带,且随着氧流量的逐渐增加发光强度逐渐减弱.在氧气氛中 900℃退火 2 h 处 理后,发光强度减弱,进一步证实氧空位缺陷是  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 纳米材料发光的主要因素.

- [1] Zoltan H , Jozsef M , Gabor K 1999 J. Appl. Phys. 86 3792
- [2] Wu X C, Song W H, Huang W D, Pu M H, Zhao B, Sun Y P, Du J J 2000 Chem. Phys. Lett. 328 5
- [3] Rustum Roy, Hill V G, Osborn E F 1952 J. Am. Chem. Soc. 74 719
- [4] Tippins H H 1965 Phys. Rev. A 140 316
- [5] Nogales E , Mendez B , Piqueras J 2005 Appl. Phys. Lett. 86 113112
- [6] Bezryadin A , Lau C N , Tinkham M 2000 Nature 404 971
- [7] Feng P , Xue X Y , Liu Y G , Wan Q , Wang T H 2006 Appl. Phys. Lett. 89 112114

- [8] Sears G W 1953 Acta Metall . 1 457
- [9] Sears G W 1955 Acta Metall. 3 361
- [10] Sears G W 1955 Acta Metall. 3 367
- [11] Harwig T, Kellendonk F 1978 J. Solid State Chem. 24 255
- [12] Blasse G, Bril A 1970 J. Phys. Chem. Solids 31 707
- [13] Binet L , Gourier D 1998 J. Phys. Chem. Solids 59 1241
- [14] Jalilian R , Yazdanpanah M M , Pradhan B K , Sumanasekera G U 2006 Chem. Phys. Lett. 426 393
- [15] Huang Y, Yue S L, Wang Z L, Wang Q, Shi C Y, Xu Z, Bai X D, Tang C H, Gu C Z 2006 J. Phys. Chem. B 110 796

## Influence of oxygen pressure on the structure and photoluminescence of β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nano-material prepared by thermal evaporation \*

Ma Hai-Lin Su Qing Lan Wei Liu Xue-Qin<sup>†</sup>

( Department of Physics , Lanzhou University , Lanzhou 730000 , China )

#### ( Received 30 March 2008 ; revised manuscript received 12 May 2008 )

#### Abstract

We have prepared the gallium oxide ( $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) nanomaterials from gallium and oxygen by thermal evaporation in the argon atmosphere and researched their photoluminescence (PL). X-ray diffraction (XRD) revealed that the synthesized products are monoclinic gallium oxide, and its morphology as observed by the scanning electron microscope (SEM) revealed that Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanobelts with breadth less than 100 nm and length of several micrometers are synthesized under low oxygen pressure, while nanoparticles are synthesized under high oxygen pressure. Room-temperature photoluminescence under excitation of 325 nm shows that the  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanostructures have stable emission at 516 nm, which may be related to the defects such as the oxygen vacancies and the gallium-oxygen vacancy pairs.

Keywords : photoluminescence , oxygen pressure , nanostructure ,  $Ga_2O_3$ PACC : 7855E , 7360L , 6170A

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 50402024, 50872047).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail:xqliu@lzu.edu.cn